

CVD/エッチング/ALD装置対応プロセスガスモニタ Qulee RGM2-201F

半導体および電子部品市場は、激しい競争の中でますます微細化が進んでおり、近年、各種真空装置の歩留まり管理が重要視されています。しかしながら、これまでCVDやエッチングプロセスに関しては、腐食性の高いガス雰囲気に対する適切な対応が進んでおりませんでした。当社では、このような環境下でも使用可能な独自の磁石付きクローズドイオンソースを採用したRGA(プロセスガスモニタ)を開発し、長寿命化やフットプリントの縮小、メンテナンス性の向上を実現致しました。

是非とも、プロセスの管理を強化してみませんか？



日本真空工業会/JVIA表彰
2023年度
真空コンポーネント大賞受賞商品

Qulee RGM2-201Fの特徴



コンパクトサイズ

- 👍 排気系・制御系一体型
- 👍 横置きでも縦置きでもOK

縦置き状態
240x350mm



生産装置での安定稼働

- 👍 磁石付きクローズドイオンソースの採用（高感度・長寿命）
- 👍 ファラデーカップ検出器の採用（定期的な感度校正が不要）



メンテナンスが簡単

- 👍 直交型ガス導入方式によりフィラメント交換が簡単(120分→約10分)



ランニングコスト削減

- 👍 フィラメント2本
- 👍 二次電子増倍管を不採用



操作性の向上

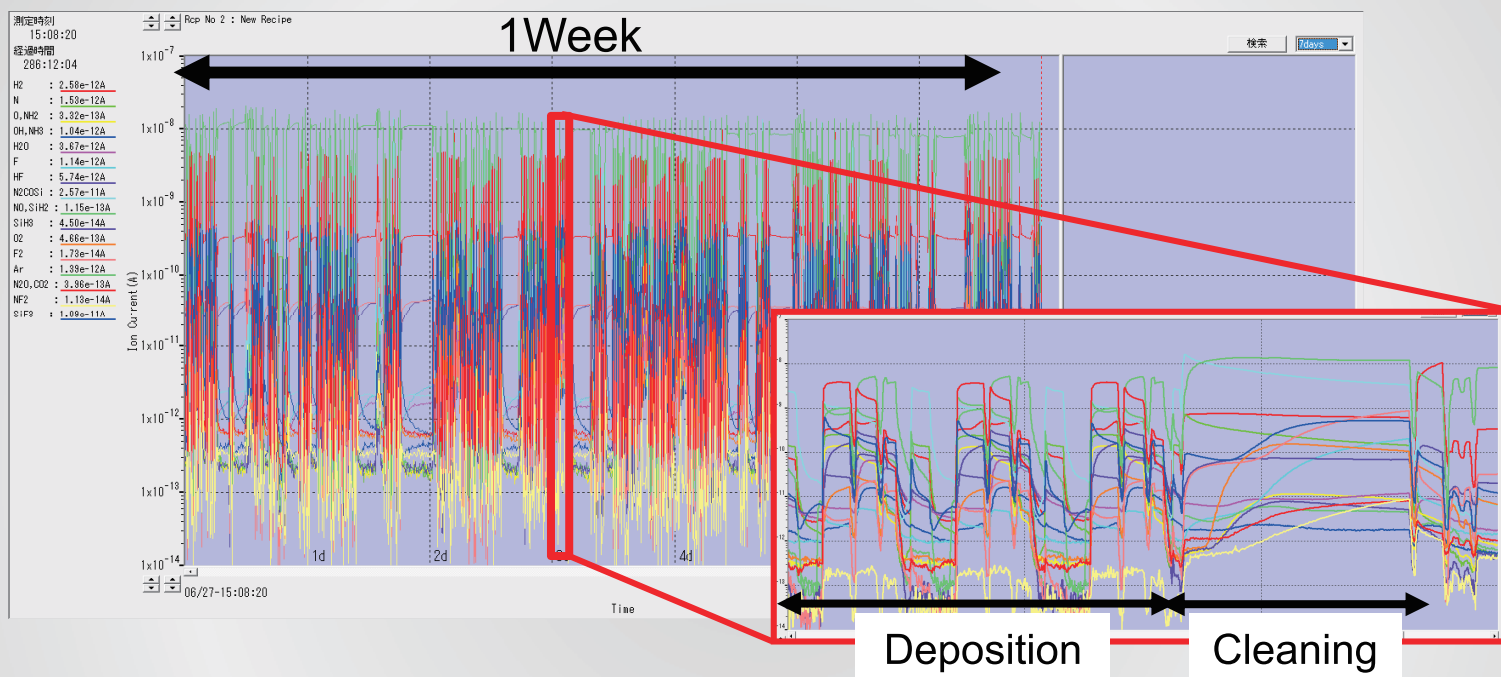
- 👍 オールPC制御+装置連動
- 👍 タッチパネルにより現況確認が可能

CVD/エッチング/ALD装置で このようなガスを管理する必要はありませんか？

ガス種	NH_3	F_2	NF_3	CF_4	SiF_4	WF_6
m/z	17	19,38	52,71	69,88	85,104	184

測定例

アルバック独自の磁石付きクローズドイオンソースの採用により、連続測定においても安定した測定結果を得ることができます。



質量数範囲 (amu)	1~200
測定圧力範囲	0.5~30Pa/10~500Paより選択
分解能(M/ ΔM)	M/ ΔM=1M (10%PH.)
検出器	ファラデーカップ
感度 (A/Pa) ※1)※2)	1e-5A/Pa (Ie=50uA)
最小検知分圧(Pa)※1)	e-10Pa台(EE50V、Ie500uA時)
全圧測定機能	あり
イオン源	磁石付きクローズドイオンソース
フィラメント	Ir/Y ₂ O ₃ 2本 (うち1本は予備)
外形寸法 (mm)	502×230×420(WDH)
フォアポンプ	なし (装置フォアポンプを使用)

※1) 予備フィラメントは適用外。

※2) 感度は使用ガス種・圧力・履歴によって変動。

株式会社アルバック コンポーネント事業本部
営業部
0467-89-2416



RGM2-201F 紹介ページ



Youtube

